

## А.В. Чернышов

## АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТЕЙ БЕСКОНТАКТНОГО МЕТОДА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ТФХ МАТЕРИАЛОВ

Разработан бесконтактный частотноимпульсный по тепловому воздействию метод неразрушающего контроля (НК) теплофизических характеристик (ТФХ) материалов, сущность которого заключается в следующем [1].

## Рис. 1 Схема устройства, реализующего бесконтактный метод НК ТФХ материалов

Над исследуемым объектом 1 (рис. 1) помешают точечный источник тепловой энергии 2 (лазер) И термоприемник 3, сфокусированный на поверхность, подверженную тепловому воздействию, И регистрирующий температуру этой поверхности по ее электромагнитному излучению. Первоначально термоприемник фокусируют В точку поверхности исследуемого объекта, находящуюся на расстоянии R<sub>1</sub> от центра пятна нагрева и перемещение источника начинают энергии термоприемника над исследуемым изделием со скоростью V. Сигнал с термоприемника, пропорциональный избыточной температуре в контроли-

руемой точке поверхности исследуемого объекта, усиливается усилителем 4 и поступает на первый вход вычитающего устройства 5, на второй вход которого подается с блока 6 напряжение, моделирующее значение заданной

температуры T<sub>1зад</sub>. Разностный сигнал с выхода вычитающего устройства 5 через аналого-цифровой преобразователь 7 поступает в микропроцессорное устройство 8. В зависимости от величины разностного сигнала в микропроцессоре вычисляется значение кода, который подается на управляемый делитель частоты 9 и определяет коэффициент деления опорной частоты, подаваемой с генератора тактовых импульсов 10. Результирующая частота подается на блок управления 11 оптическим затвором 12. Последний осуществляет частотно-импульсную модуляцию луча лазера 2. Изменение частоты подачи тепловых импульсов от источника тепла (лазера) осуществляется до тех пор, пока контролируемая избыточная температура поверхности исследуемого объекта станет равной заданному значению  $T_{13ap}$ , т.е.  $T(R_1) = T_{13ap}$ . При этом разностный сигнал на выходе вычитающего устройства 5 отсутствует, а в оперативной памяти микропроцессора  $\delta$  фиксируется частота подачи тепловых импульсов от источника  $F_{x1}$ , значение которого может быть вызвано оператором на индикаторное устройство 13. Затем по команде с микропроцессора 8 блок механического изменения расстояния между источником и термоприемником 14 переносит термоприемник на расстояние R<sub>2</sub> от пятна нагрева источника тепла. Далее аналогично вышеописанным процедурам осуществляется изменение частоты подачи тепловых импульсов от источника тепла до тех пор, пока контролируемая избыточная температура на расстоянии  $R_2$  станет равной заданному значению  $T_1$ , т.е.  $T(R_2) = T_{13a\pi}$ .

При этом в оперативной памяти микропроцессора фиксируется найденная частота тепловых импульсов  $F_{x2}$ . Величина избыточной температуры  $T_{1_{3ад}}$  задается в диапазоне 30...50 % от температуры термодеструкции исследуемого материала. Искомые ТФХ определяются по формулам:

$$a = \frac{VR_1}{2\ln 3\frac{F_{x1}}{F_{x2}}},$$
 (1)

$$\lambda = \frac{F_{x1}q_0}{2\pi T(R_1)R_1} \exp\left(-\frac{V(R_1 - x)}{2a}\right),$$
 (2)

Проведем анализ погрешностей результатов измерений тепло- и температуропроводности а и  $\lambda$  на аналитической основе используя подход, изложенный в работе [2]. В соответствии с уравнением (1) полная погрешность  $\Delta a_j^*$  зависит от точности установления V, R<sub>1</sub>, а также от точности измерений  $F_{x1}$  и  $F_{x2}$ . Следовательно, полная погрешность (без учета погрешности округления) результатов измерения а будет определяться выражением:

$$\Delta a_{j}^{*} = a_{j}^{*} - a_{j} = \Delta_{V} a_{j}^{*} + \Delta_{R_{1}} a_{j}^{*} + \Delta_{F_{X1}} a_{j}^{*} + \Delta_{F_{X2}} a_{j}^{*},$$

где  $\Delta_V a_j^* = \frac{\Delta V R_1}{2 \ln \left[ 3 \frac{F_{x1j}}{F_{x2j}} \right]}$  – погрешность, обусловленная отличием V от истинного значения  $V_{\mu}$ , т.е.  $V = V_{\mu} +$  $\Delta V; \quad \Delta_{R_1} a_j^* = \frac{V\Delta R}{2\ln\left[3\frac{F_{x1_j}}{F_{x2_j}}\right]} - \text{погрешность, обусловленная отличием } R_1 \text{ от } R_{1u} (R_1 = R_{1u} + \Delta R_1);$  $\Delta_{F_{x1}}a_{j}^{*} = \frac{V \cdot R_{1}}{2} \cdot \left| \frac{1}{\ln \left[ 3 \frac{F_{x1uj} + \Delta F^{*}_{x1j}}{F_{x1}} \right]} - \frac{1}{\ln \left[ \frac{F_{x1uj}}{F_{x1}} \right]} \right| - \text{погрешность, обусловленная отличием } F_{x1} \text{ от } F_{x1u} (F_{x1} = 1)$  $F_{x1y} + \Delta F_{x1}$ ;  $\Delta_{F_{x2}} a_{j}^{*} = \frac{VR_{1}}{2} \left[ \frac{1}{\ln \left[ 3 \frac{F_{x1j}^{*}}{F_{x2uj} + \Delta F_{x2j}^{*}} \right]} - \frac{1}{\ln \left[ \frac{F_{x1j}^{*}}{F_{x2uj}} \right]} \right] - \text{погрешность, обусловленная отличием } F_{x2} \text{ от } F_{x2u} (F_{x2} = 1)$ 

 $F_{x2y} + \Delta F_{x2}$ 

Рассмотрим далее уравнение (2). Его структура показывает, что полная погрешность  $\Delta \lambda_j^*$  зависит от точности установления  $q_0, R_l, V$ , а также от точности измерений  $T_1^*(R_1), F_{xl}^*, x^*, a^*$ . Следовательно,

$$\Delta \lambda_j^* = \Delta_{q_0} \lambda_j^* + \Delta_{F_{x_1}} \lambda_j^* + \Delta_V \lambda_j^* + \Delta_{R_1} \lambda_j^* + \Delta_x \lambda_j^* + \Delta_{T(R_1)} \lambda_j^* + \Delta_a \lambda_j^*,$$

где  $\Delta_{q_0} \lambda_j^* = \Delta q_0 \frac{F_{x_{1j}}}{2\pi T_j(R_1)R_1} \exp\left(-\frac{V(R_1 - x)}{2a_j}\right)$  – погрешность из-за отличия  $q_0$  от  $q_{0\mu}$  ( $q_0 = q_{0\mu} + \Delta q_0$ );  $\Delta_{--} \lambda_j^* = \Delta E^*$  –  $q_0$  ( $V(R_1 - x)$ )

$$\Delta_{F_{x1}}\lambda_j^* = \Delta F_{x1j}^* \frac{q_0}{2\pi T_j(R_1)R_1} \exp\left(-\frac{V(R_1-x)}{2a_j}\right) - \text{погрешность, обусловленная отличием } F_{x1} \text{ от истинного}$$

значения  $F_{r1\mu}$ ;

$$\Delta_V \lambda_j^* = \frac{F_{xj}^* q_0}{2\pi T_j(R_1) R_1} \left[ \exp\left(-\frac{\left(V_{\mu} + \Delta V_j^*\right)(R_1 - x)}{2a_j}\right) - \exp\left(-\frac{V_{\mu}(R_1 - x)}{2a_j}\right) \right] - \text{погрешность, обусловленная отличием}$$

V от истинного значения  $V_{\mu}$ .

Аналогично определяются погрешности, обусловленные отличием x от  $x_u$ , a от  $a_u$ ,  $T(R_1)$  от  $T_u(R_1)$ .

Полученные соотношения для определения составляющих полной погрешности позволяют выделить доминанты и определить характеристики этих погрешностей. В табл. 1 представлены результаты выделения доминант.

Параметр		$R_1$	x	$F_{x1}$	$F_{x2}$	$T(R_1)$	а	$q_0$	V
Максимальное	δa	12	-	16	54	-	-	-	12
отклонение, %	δλ	38	49	11,4	_	15,6	23	11,4	56

Примечание: отклонение каждого параметра задавалось ±10 % при постоянстве остальных.

Анализ полученных результатов (табл. 1) показывает, что из четырех компонент a доминирует  $F_{x1}$ , а далее  $F_{x2}$ ,  $R_1$  и V. Для  $\lambda$  доминируют V, x и  $R_1$ , далее по степени значимости следуют a,  $T(R_1)$ ,  $F_{x1}$  и  $q_0$ .

Полученная информация о доминирующих компонентах и их вкладе в общую погрешность позволяет целенаправленно влиять на источники погрешностей, что в итоге будет способствовать повышению метрологического уровня представленного в работе метода неразрушающего контроля ТФХ материалов и готовых изделий.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 Патент РФ № 200117813. Способ бесконтактного контроля ТФС материалов и устройство для его осуществления / А.В. Чернышов, Э.В. Сысоев. Заявл. 26.06.2001; Опубл. 11.03.2003.

2 Чернышова Т.И., Чернышов В.Н. Методы и средства неразрушающего контроля теплофизических свойств материалов. М.: Машиностроение, 2001. 241 с.

Кафедра «Криминалистика и информатизация правовой деятельности»